

# 熊本大学工学部附属工学研究機器センター 機器利用料金

名称等	料金 (円)	利用単位	備考
粉末X線回折装置 株式会社リガク UltimaIV	3,000/日 または 1,500/半日	1日 または 半日 (9~13時, 13~17時)	※放射線取扱者登録が必要
薄膜・微小部X線回折装置 株式会社リガク Smart Lab			
蛍光X線分析装置 株式会社リガク Primus II			
ICDD検索システム PDF-4 <sup>+</sup> 2016	20,000	年間	年間、何度でも使用可
電子線マイクロアナライザ 株式会社島津製作所 EPMA-1720HT	1,250	1時間	使用時間が4時間未満の場合
	5,000	1日	使用時間が4時間以上の場合
走査電子顕微鏡 日本電子株式会社 JSM-6390LV + EBSD	1,000	1時間	蒸着装置、凍結乾燥機の使用料を含む。
イオンリング装置 株式会社日立ハイテクノロジーズ E-3500	100	1時間	専用ホルダ:¥8,640-
金スパッタリング・カーボン蒸着装置 株式会社日立ハイテクノロジーズ E-1010	100	1分 または 1回	金はスパッタ時間、カーボンは蒸着回数で精算
凍結乾燥装置 日本電子株式会社 JFD-300	100	1回	
紫外可視近赤外分光光度計 株式会社島津製作所 UV-3600	100	1時間	
3Dプリンタ 株式会社キーエンス アジリスタ3110	50円/g	重量(g)	モデル、サポート材の合計重量
(先進材料ナノ構造解析システム室) 年間ユーザー登録	120,000	年間	TECNAI F20, NB5000 を利用する ユーザーにグループ単位で課金
(先進材料ナノ構造解析システム室) 電解放出型走査透過電子顕微鏡 FEI TECNAI F20	12,000	1日	AM10:00~PM5:00
(先進材料ナノ構造解析システム室) 集束イオン・電子ビーム加工観察装置 株式会社日立ハイテクノロジーズ NB5000	6,000	1日	予約日のAM10:00から翌日AM10:00まで
透過型電子顕微鏡 日本電子株式会社 JEM-2100Plus	未定	1時間	¥2,000/時間程度を予定

名称等	料金 (円)	利用単位	備考
電解放出型走査電子顕微鏡 日本電子株式会社 JSM-7600F	2,000	1時間	
クライオ対応ウルトラマイクローム Leica EM UC7	0 (※ 400)	(※ 1時間)	FE-SEMの付帯装置 ※付帯装置のみ使用の場合使用料金400円/h
マルチコーター(Pt, Au, Pd, C) 株式会社真空デバイス VES-10	0 (※ 400)	(※ 1回)	FE-SEMの付帯装置 ※付帯装置のみ使用の場合使用料金400円/ 回
親水化装置 株式会社真空デバイス PIB-10	0 (※ 400)	(※ 1時間)	FE-SEMの付帯装置 ※付帯装置のみ使用の場合使用料金400円/h
凍結乾燥機 日本電子株式会社 JFD-320	0 (※ 400)	(※ 1時間)	FE-SEMの付帯装置 ※付帯装置のみ使用の場合使用料金400円/h
オスミウムコーター 株式会社真空デバイス HPC-1SW	0 (※ 300)	1回	FE-SEMの付帯装置 ※付帯装置のみ使用の場合使用料金300円/ 回

本表記載の料金は2023年5月現在のものです。

### お問合せ先

熊本大学 技術部 材料評価WT / 化学分析WT  
 TEL/FAX : 096-342-3518 or 096-342-3879  
 E-mail : [erec@eng.kumamoto-u.ac.jp](mailto:erec@eng.kumamoto-u.ac.jp)